

LITHOGUARD[®]-12 は、ArF 液浸露光を始めとするハイエンド半導体露光装置向けに開発された、酸性・塩基性・凝縮性有機ガス除去用 HEPA フィルタ付高効率ケミカルフィルタシステムです。

また LITHOGUARD[®]-12 は、低濃度環境下においても高い汚染物質除去性能を発揮するため、超清浄環境が要求されるプロセスの実現や光学系部品の汚染による性能低下の防止にも最適です。

特長

- 高効率ケミカルフィルトレーション (>99%)
- 長寿命 (LPS または BSMmax フィルタ搭載)
- 省スペース
- 低コスト (Refill プログラムによるフィルターの再生利用)
- HEPA フィルタ搭載 (>99.97%)
- 操作用電源および気密用の圧縮空気 (CDA, N₂ 等) 不要
- ガス分析用サンプリングポート付

フィルタ構成

- LPS または BSMmax ケミカルフィルタ × 12 枚
- HEPA フィルタ × 6 枚

仕様

システム品番	KAX007890
ケミカルフィルタ品番	P512612
設定風量	2,600 m ³ /hr
寸法	幅 850mm x 高さ 1,850mm x 奥行 1,200mm
概算重量(フィルター込)	600 kg
操作用電源	不要
気密用圧縮空気	不要



※本記載内容は予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。